

# 地方創生センター2号館機器使用料一覧

通し番号	機器名称	管理責任者	単位	研究員単価	研究員以外の単価
1	ディスク型手動粉碎機	柴山	時	50	100
2	撃型粉碎機	柴山	時	50	100
3	ロール型磁選機	柴山	時	0	30
4	空気テーブル	柴山	時	0	50
5	日東高圧 卓上型0.2tオートクレーブ HC-276 20MPa	柴山	時	50	100
6	エリーズ非鉄金属選別器ECS 1222 ラボモデル	柴山	時	30	100
7	紫外可視近赤外分光光度計	柴山	時間	350	700
8	波長分散小型蛍光X線分析	柴山	個	200	400
9	付属消耗品:成形リング	柴山	個	60	60
10	イオンクロマトグラフ ICS-3000型	柴山/芳賀	時	100	300
11	蒸留水製造装置 RFD240NA	柴山	ℓ	0	10
12	超純水製造装置 RFU464CA	柴山	ℓ	10	30
13	湿式高磁力磁選機 HIW L-4ラボモデル	柴山	時	50	200
14	湿式粉碎機(アトライタ) MA01SC型	柴山	時	50	200
15	粒度分布測定装置 MT3300EX-SDU	柴山/芳賀	時	100	300
16	拡散反射測定ユニット60φ積分球付属装置 ISR-3100(UV-3600用)	柴山	時	100	300
17	卓上型高周波ビードサンプラー	柴山/芳賀	試料	100	200
18	EXAFS装置	高崎	回	1100	3300
19	ICP発光分光分析装置	芳賀	時	700	2100
20	直流安定化電源	高崎	時	0	100
21	高周波誘導加熱装置	齋藤嘉一	回	100	250
22	AOカーンエイトフロッタ(A0ノビ・A0の普通紙)	高崎	枚	600	1800
	AOカーンエイトフロッタ(A1の普通紙)	高崎	枚	300	900
	AOカーンエイトフロッタ(A0ノビA0の光沢紙薄口)	高崎	枚	900	2500
	AOカーンエイトフロッタ(A1の光沢紙薄口)	高崎	枚	450	1250
	AOカーンエイトフロッタ(A0ノビ・A0、用紙持ち込み時)	高崎	枚	500	1600
	AOカーンエイトフロッタ(A1の普通紙、用紙持ち込み時)	高崎	枚	250	800
23	真空アーク溶解炉	肖	個	100	250
24	紫外可視分光光度計	高崎	時間	100	300
25	金属用ラボカッター	高崎	時間	100	300
26	施盤	高崎	時間	100	300
27	電磁ふるい振とう機	高崎	時間	100	300
28	多層構造膜作製装置	長谷川	日	500	1500
29	多元合金膜作製装置	長谷川	日	500	1500
30	純水製造装置	長谷川	ℓ	10	30
31	精密天秤	長谷川	時間	0	50
32	高真空熱処理装置	長谷川	時	50	150
33	カー効果磁化・磁区観察装置	長谷川	時間	50	150
34	パルス磁場印加装置	長谷川	時間	50	150
35	垂直磁場磁気力顕微鏡装置	長谷川	時間	50	150
36	熱ドリフト補正型磁気力顕微鏡装置	長谷川	時間	50	150
37	高真空型走査プローブ顕微鏡	吉村	時	50	150
38	高感度磁化測定装置	吉村	時	70	200
39	液体窒素	吉村	ℓ	100	150
40	表面粗さ測定装置	吉村	分	1	3
41	多目的X線回折装置	吉村	時	70	200
42	偏光顕微鏡	吉村	時	0	100
43	均温熱処理装置	吉村	時	50	150
44	磁気記憶装置材料分析・評価システム	吉村	日	1000	5000
45	粉末X線回折装置	大川・吉村	時	100	300
	粉末X線回折装置	大川・吉村	枚	10	20
46	形状測定レーザマイクロスコープ VK-X200/210SP	吉村	分	1	3
47	振動試料型磁力計	吉村	時	50	100
48	走査電子顕微鏡(SEM)	齋藤嘉一	時	100	250
49	カーボンコーター	齋藤嘉一	回	50	150
50	イオンコーター	齋藤嘉一	回	50	150
51	薄膜X線回折装置	齋藤嘉一	時	100	250
52	システム実体顕微鏡	齋藤嘉一	時	0	100
53	微小空間組織構造評価装置(FE-SEM) JSM-7800F	齋藤嘉一	時	500	1500
54	大気型走査プローブ顕微鏡	寺境	時	50	150
55	示差熱天秤 TG-DTA	小笠原	時	50	150
56	小型精密切断機	高橋護	時	0	0
57	超高温小型真空、雰囲気炉ニュートリアンパスカル40	林正彦	時	50	150
58	プラスチック種類判別計	松村	時	50	150
59	PCRサーマルサイクラー	小泉	時	10	50
60	電界放射型走査電子顕微鏡	林	時	70	200
61	卓上型プラズマ発光分光分析装置	林・村上英樹	時	600	2000
62	ナノ粒子粒径解析/ゼータ電位計	小笠原	分	1	3
63	Agilent 630 FT-IR システム	小笠原	分	2	5
64	金属分散度測定装置 BEL-METAL-1SPAI	進藤	時	50	100